

工艺气体用压力传感器

Model: **HYW**

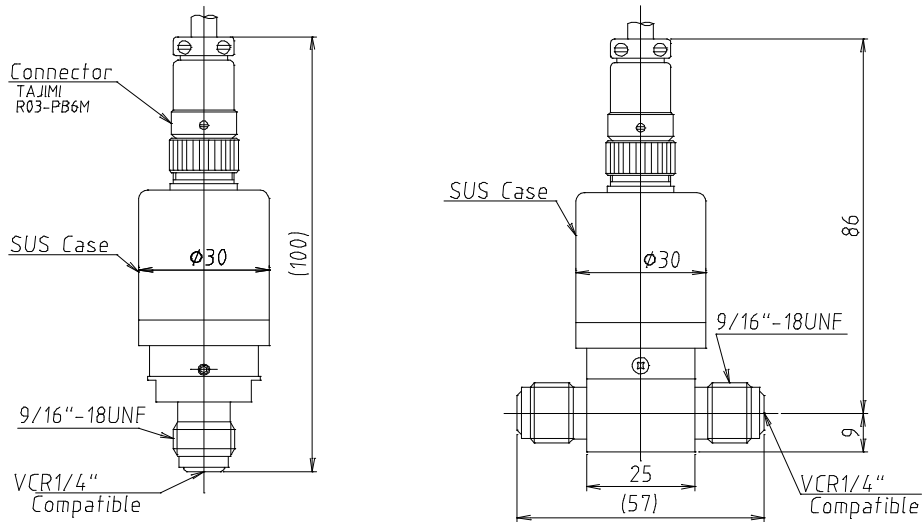
半导体制造设备用
高耐腐蚀哈氏合金隔膜

Tem-Tech Lab.



- ✓ 适用于CC, BSGS的高精度压力传感器
 - ✓ 隔膜材为耐腐蚀性高的哈氏合金C-22
 - ✓ 能对应35MPa的高压范围
-
- 表压、级联压均可制作
 - 减低了热膨胀应变、提高了温度安定性
 - 直线性为 $\pm 0.3\%$ FS的高精度
 - 标准的传输信号为国际规格的2线式4-20mA * 可对应电压输出
 - 可在安装现场做零点校正
 - 安全度高的无充填液干性压力传感器

Tem-Tech Lab.



测定流体	半导体工艺气体	
接触流体部材质	隔膜: 哈氏合金(C-22) 本体: SUS316L	
测定范围	0 (-0.1) — 0.5、1、2、3.5、20、25、35MPa	
許容限度压力	20MPa未満: 定格压力×2倍、20MPa: ×1.5倍	
电源电压	DC24V ±10%	DC15~24V
输出信号	4~20mADC (2线式)	1~5VDC (3线式)
综合精度	±0.3%FS (含直线性・迟滞性・再现性)	
温度补偿范围	0~60℃ (无结冰、结露状态)	
动作温度范围	0~80℃ (无结冰、结露状态)	
温度特性	±0.05%FS / °C (温度补偿范围内)	
保护等级	IP55相当 ※室内规格	
接头规格	VCR, UJR (其他可相谈)	
接头尺寸	1/4"、3/8"、1/2" (其他可相谈)	
电线连接	可拆卸式TAJIMI连接	
附属电线	3m 標準 (2芯+地线線)	3m 標準 (3芯+地线)
密封方法	特殊电子光束焊接	
泄漏量	<5 × 10 ⁻¹² Pam ³ / sec	
内面清洁度	Ra: <0.25μm以下	

◀ 型式构成标准形式例: HYWSMV-420TC1

型式	形状	接头形状	接头种类	—	模拟输出	信号连接	接头尺寸	
HYW	S	S型	M 公头一体型	V VCR对应	120	4-20mA	P 直出电线	C1 1/4"
			N 公头	U UJR	105	1-5V	T 螺丝式连接 (TAJIMI)	C2 3/8"
	T	T型	F 母头	1 VCR认定			X 卡锁式连接 (BENDIX)	C3 1/2"
			P 螺纹式	2 UJR认定				

Tem-Tech Lab.

株式会社 テムテック研究所

本社: 〒104-0052 東京都中央区月島 2-7-13

TEL:03-3534-5320 (代表)

FAX:03-3534-5322

大阪営業所: 〒582-0026 大阪府柏原市旭ヶ丘2-14-27 #104号

TEL:080-5705-9270

URL: <https://www.tem-tech.co.jp> Email: sales@tem-tech.co.jp (代表)

代理店

德欣貿業有限公司

總公司: 彰化市聖安路728號

TEL:04-7329966 FAX:04-7329933

分公司: 新竹縣竹北市文信路17號1F

TEL:03-558-8175 FAX:03-558-8173

E-mail: aryan@direction-auto.com.tw

<https://www.direction-auto.com.tw>